ステップエッジと触媒活性[†]

N(111)上でのH₂S および CO の解離

北田暁彦・平島秀水・小川淳也

中野美尚・松本健俊・中村潤児

筑波大学大学院数理物質科学研究科物性・分子工学専攻 西 305 8573 茨城県つくば市天王台111

(2004年5月25日受付;2004年7月21日掲載決定)

Step-edges and Catalytic Activity Dissociation of H₂S and CO on Ni(111)

Akihiko KITADA, Hidemi HIRASHIMA, Junya OGAWA,

Haruhisa NAKANO, Taketoshi MATSUMOTO and Junji NAKAMURA

Graduate School of Pure and Applied Sciences, University of Tsukuba 1 1 Ten-nodai, Tsukuba, Ibaraki 305 8573

(Received May 25, 2004 ; Accepted July 21, 2004)

The effect of step-edges on the dissociative adsorption of H₂S has been studied on a Ni(111) surface using scanning tunneling microscopy (STM), Auger electron spectroscopy (AES) and low energy electron diffraction (LEED). Exposure of Ni(111) to H₂S at room temperature results in the formation of S islands with the structures of $p(2 \times 2)$ and reconstructed $c(5\sqrt{3} \times 9)$ rect in the vicinity of step-edges. Subsequently, H₂S dissociates on the terrace of Ni(111), leading to the formation of unique S species with a string structure. The STM observation indicates that the dissociation of H₂S takes place on both step-edges and terraces. The dissociative adsorption of CO as well as formation of carbide islands also take place preferentially at the step-edges. It is thus suggested that a small amount of sulfur located at step-edges effectively deactivate CO dissociation in the methanation reaction.

1.はじめに

メタネーション反応は CO と H₂ の混合ガスからメタ ンを生成する反応(CO+3 H₂ CH₄+H₂O)であり,Ni はその活性および選択性の高さと価格の低さから広く用 いられている。メタネーション反応のメカニズムとして, Ni 表面で CO が解離吸着し,表面のカーバイドが水素 化されることにより起こることが一般に受け入れられて いる。

本研究では,メタネーション反応において著しい触媒 被毒を引き起こす硫黄の効果に着目した。Ni 触媒表面 に微量の硫黄が存在するとメタネーション反応に対する 触媒活性が著しく減少することが知られている。Goodman ら¹は Ni 単結晶のモデル触媒を用いメタネーショ ン反応における Ni 触媒が構造鈍感であると示し,H₂S の解離吸着による少量のSが引き起こす急激な触媒の 失活がS原子によって多数のNi表面原子の電子状態が 変化するためであると考察している。しかし,別の可能 性がある。すなわち,触媒表面に少量存在する活性点が 硫黄によって優先的に被毒される可能性である。そこで 我々はメタネーション反応における活性点の1つと考え られるステップエッジに注目した。実際にステップエッ ジが活性点となる素過程がいくつか報告されている。例 えばErtl ら²はRu(0001)上でのNOの解離吸着反応に おいてNOがステップエッジで解離し,生成したNと

 ^{*} 第 23 回表面科学講演大会(2003 年 11 月 26 日~11 月 28 日)にて発表

E-mail: s-kitada@ims.tsukuba.ac.jp

O原子のステップエッジからの拡散を走査型トンネル顕 微鏡 STM)で観察している。また , Dahl ら³)は Ru(0001) 表面上で 0.01~0.02 ML の微量の Au を蒸着すると N2 の解離速度が激減することを示した。これは, Ru(0001) 表面上に少量存在するステップエッジが N2の解離吸着 に高活性なサイトであり, Au 原子によって被覆されて 活性を失ったものと説明されている。このように少量存 在するステップエッジなどの表面欠陥が反応に及ぼす効 果を検討するには,オージェ電子分光法(AES)や低速 電子回折(LEED)などマクロな表面分析装置よりも, STM などの局所的表面構造を観察する手法が必要であ る。我々は, Ni(111) 表面の H₂S の解離吸着による硫 黄吸着構造とそのステップエッジの効果を調べ,これま で研究してきた CO の解離の結果と合わせて, メタネー ション反応における活性点と硫黄による触媒被毒の機構 について新しいモデルを提示する。

2.実 験

実験には AES, LEED,四重極質量分析計(Q-Mass) を備えた超高真空 STM 装置(ユニソク USM-801)を用 いた。純度 99.99%の N(111)単結晶(10 ¢×1 mm) を試料とした。サンプルはシリコン基板の上にのせ,シ リコン板を通電加熱することにより Ni単結晶を加熱し た。サンプル側面に取り付けたアルメル クロメル熱電 対により温度を測定した。N(111)清浄表面は Ar⁺スパ ッタリングおよび 1000 K アニーリングを繰り返すこと により得られた。

H₂Sの解離による硫黄の吸着は,300 K で,100 倍に Ar で希釈した H₂S ガスを $1 \times 10^{-7} \sim 2 \times 10^{-7}$ Torr 導入 することで行った。STM 測定には KOH 水溶液中で電解 研磨した W チップを用いた。LEED 像の観察および AES 測定は STM 観察の後で行った。酸素(θ_0)と硫黄(θ_s), そして炭素(θ_c)の被覆率は室温での酸素が飽和した 時(θ_0 =0.25)の AES ピーク強度比 O₅₁₀/Ni₈₄₈ を基準 とし,O₅₁₀/Ni₈₄₈,C₂₇₂/Ni₈₄₈,S₁₅₂/Ni₈₄₈ と AES 感度比⁴⁾ により決定した。ここでは θ =1 が表面の Ni 原子の数 に対応するものとする。

3.結果と考察

3.1 S/Ni(111) 表面の STM 像

Fig.1はH₂Sを300Kで1.0L導入した後のN(111) 表面のSTM像である。STM測定の前に加熱はしていな い。この像から帯状に成長するアイランド(A)とテラ スに分布する粒子状の構造(B)が観察された。アイラ ンド(A)はステップエッジから垂直方向に優先的に成 長している。さらに走査範囲を狭めたときのステップエ



Fig. 1. STM topograph of a Ni(111) surface with step-edges after exposure to 1.0 L H₂S (1200 × 1200 2 , V_s = - 0.50 V, I_t = 0.60 nA). Islands (A) and clusters (B) were observed.



Fig. 2. STM current image of a Ni(111) surface with a stepedge after exposure to 0.6 L H₂S (200 × 200 ², $V_s = -0.01$ V, I_t = 0.60 nA). Islands and clusters in Fig. 1 were observed as a mixture of the structures with a rectangle (A) and triangle (C) unit cells, and a string structure (B), respectively.

ッジ近傍の STM 像を Fig. 2 に示す。Fig. 1 と Fig. 2 を較 べることによりステップエッジ近傍には三角形(C)と 長方形(A)の格子をもつアイランドが生成し, テラス 上分布するのはひも状の構造(B)であることがわかっ



Fig. 3. STM current image of a Ni(111) terrace wider than 1000 observed after exposure to 1.0 L H₂S (700 × 700 ², V_s = -0.50 V, I_t = 0.60 nA).

た。またアイランド以外の部分は清浄な Ni の (111)面 であった。Fig. 3 は N(111)上に Fig. 1 より 2 倍広い 1000 のテラスの STM 像である。ステップエッジから遠く 離れたテラス中央ではひも状構造のみが観察された。ま た Fig. 1 において STM から得られた硫黄被覆率は 0.039 であり,同様に Fig. 3 での被覆率は 0.01 であった。つ まり,ステップエッジの近傍に硫黄吸着構造が局在して いるといえる。以上の結果は三角形および長方形の単位 格子をもつアイランドはステップエッジを起点として成 長し,ひも状の物質はテラスで生成することを示してい る。すなわち,解離の活性点は単一ではないといえる。

Fig. 2 のそれぞれの吸着構造について STM 像を解析 した。アイランド(C)の三角形の単位格子の間隔は 4.97

(N(111)の最近接距離 2.49 の2倍), アイランド の高さは0.94 であり,単位ベクトルは下地のN(111) と同じ方向であった。そこでこの構造は Fig.4 に示すよ うに f(2×2)構造に帰属した。STM 像の明るい輝点が 硫黄原子1 個に対応している⁵)。STM 像の高さから added 型の mass transport を伴うような再構成ではなく, 単純な吸着構造であると考えている。

次にアイランド(A)であるが,長方形の単位格子の 長さは4.98 で,Niの最近接原子距離2.49 の2倍で あり,また見かけの高さは0.83 であった。長方形の格 子を持つアイランド(A)の構造は単位格子の形状から 下地表面第一層が表面再構成しているといえる。S/Ni (111)での表面再構成についてはLEEDによっていく つかのモデルが提案されており,いわゆる clock 再構成





Fig. 4. Magnified STM image of the triangle structure in Fig. 2 (B) and an schematic model of the $p(2 \times 2)$ -S structure (25 × 25 ², V_s = -0.01 V, I_t = 0.60 nA).

の($5\sqrt{3} \times 2$)構造⁶⁾,そして N(100)-like 再構成の ($5\sqrt{3} \times 9$) rect 構造(($\sqrt{39} \times \sqrt{39}$)R 16.1 %構造)があげら れる⁷)。格子間隔および方向から長方形の格子のアイラ ンド(A)を($5\sqrt{3} \times 9$) rect 構造に帰属した。Fig. 5 に, Fig. 2 (A)の枠内を拡大した STM 像と($5\sqrt{3} \times 9$) rect 構造のモデル図を示した。



Ni(111) 2nd layer
Ni(100)-like 1st layer

Fig. 5. Magnified STM image of the rectangle structure in Fig. 2 (A) and an schematic model of the $c(5\sqrt{3} \times 9)$ rect structure. The first layer of the Ni substrate is considered to reconstruct into the Ni(100)-like structure ($58 \times 58 \ ^2$, V_s = -0.01 V, I_t = 0. 60 nA).

最後にひも状物質であるが,高さ,長さ,幅はそれぞれ1.6,10~30,7 であり,方向はすべてN(111)の最密充填方向に揃っている。AESにおいてS以外の ピークが観測されなかったため,このひも状物質は硫黄 によるものと考えられる。AESとSTMから得られた被 覆率の対応関係からひも状物質におけるS原子間の間 隔は基板 Ni 原子の最近接距離 2.49 と同じであると見 積もられた。そうすると,ひも状物質はS原子が短い もので5個(10),長いもので13個(30)連なって いると考えられる。

S/N(111)の STM研究は Marcus ら⁸)および Besenbacher ら⁹によって報告されている。Marcus ら⁸は Ni (111)表面を1200 K で加熱し,バルク中の硫黄を析出 させることによって S/N(111)表面を作っている。彼 らは硫黄の (5√3×9) rect 構造アイランドを観察して おり,我々とアイランドの格子の形状,格子間隔,方向 が一致し,S アイランドがステップエッジに局在するこ とも一致する。彼らの結果はバルク内の硫黄がステップ エッジから表面に析出することを意味する。H2S から S を供給した場合と同様な再構成構造を与えることから, 表面再構成はステップエッジから起こると考えられる。

Besenbacher ら⁹は室温で清浄な Ní(111) 表面に H₂S を徐々に導入し, in-situ での STM 測定を行っている。 彼らは特にステップエッジの効果を調べているわけでは ない。しかし, H₂Sを0~0.2L導入したときステップエ ッジに g(2×2)S構造のアイランド, 2.0L以上導入す るとテラス上にランダムに生成するアイランドを観察し ている。彼らの論文中では明言していないが,実験結果 はH₂S がステップエッジとテラスで解離することを意 味しており,我々の結果と矛盾しない。しかし,Besenbacherの結果と異なる点がある。彼らは12Lという大 きな露出量では $(5\sqrt{3} \times 2)$ 構造がテラスに均等に形成 され,加熱することにより(5√3×2)の大きなアイラ ンドに成長すると報告している。一方,我々はH2Sを1 L導入することにより室温でステップエッジ近傍に (5 √3 ×9) rect 構造が形成し,加熱せずともアイランド(A) が成長しているのを観察した。彼らは (5√3 ×9) rect 構造を観察していない。この違いは H₂Sの導入量およ び加熱の有無などの条件の相違,特に硫黄の被覆率の違 いが原因と考えられる。LEEDによる研究では(5√3×2) 構造⁶)と $(5\sqrt{3} \times 9)$ rect 構造⁷)の全く異なる2種の構造 が報告されているが,これは硫黄の被覆率の違いによる と報告されている10)。

3.2 H₂Sの解離のメカニズム

ステップエッジから成長する (5√3×9) rect の S ア イランドとテラスで生成するひも状構造の生成メカニズ ムについて考察する。ステップエッジからのアイランド 成長については,まず,H₂S がステップエッジで解離し, その近傍に吸着した硫黄原子は r(2×2)S 構造アイラン ドを形成する。これは N(111) 表面上で H₂S の解離は ステップエッジで優先的に解離すると報告されているこ とと一致する⁹)。その後,硫黄の局所的な被覆率が上昇 すると Ni 表面の第一層が N(100) like に再構成し, (5

S

 $\sqrt{3}$ ×9) rect 構造アイランドを形成する。ステップエッジはテラスの原子より位置を変えやすいため,安定な Ni-S 表面化合物を生成する再構成の起点となっている と考えている。さらに再構成した ($5\sqrt{3}$ ×9) rect 構造 アイランドの境界にはカチオニックな Ni 原子とアニオ ニックな S 原子が共存し,そこで H₂S また SH が H を 引き抜かれて解離しアイランドが成長すると推測され る。このとき ($5\sqrt{3}$ ×9) rect 構造では (1×1)N(111) 構造よりも 14% Ni の密度が小さく,アイランドの成長 過程でテラス上に余った Ni 原子はステップエッジへと 拡散するものと考えられる¹¹)。すなわち,ステップエッ ジからのアイランド成長において,H₂S 解離の活性点は 表面再構成によって生じるものといえる。

一方, テラスでの H₂S の解離であるが, まず, ひも 状構造の物質は何かが問題となる。Sa または HSa の可 能性があるが, Ní(100) および Ní(110) 表面に H₂S を 導入すると 170 K および 180 K 以上ではすべて Sa まで 解離すると報告されている12,13)。そこで我々はひも状 物質はSaであるとみなした。興味深いことに硫黄の一 次元物質は化合物として見いだされている14,15)。この ひも状構造の生成メカニズムであるが,実験結果よりひ も状物質がテラスにランダムに分布することから (Fig. 3), H₂S はテラスでランダムに解離するといえる。また 室温の STM 測定ではひも状物質はほとんど動かなかっ た。ひも状になるためには起点となる核生成が起こるは ずであり,また十分に速い表面拡散の素過程が必要であ る。文献によれば, Ní(100)上でH₂Sは110~160Kで 容易にHSaを生じることが知られている¹²)。またHSa の Ni(111)での吸着エネルギーは小さいと予想され16), 表面拡散の速度は大きいと考えられる。そこで, HSaの 表面反応によるひも状物質の生成メカニズムを考えた。 すなわち, HSaの表面反応により, 2 Sa というひもの核 生成が起こる。次いで,テラスでH2SがHSaへと解離 し,2Saの核へと拡散し,そこで水素が引き抜かれると いうものである。他に, H2S が表面で拡散しひもを成長 させることや 表面点欠陥が核となることも考え得るが, 現在,HSaがひも状物質の生成に深く関係していると考 えている。

3.3 硫黄による触媒被毒のメカニズム

我々は,メタネーション反応の素過程でもある CO の 解離について,N(111)表面を用いて研究してきた。Fig. 6は CO を 400 L 導入し,その後室温で測定した STM 像である¹⁷)。AES 測定で求めた炭素被覆率(θc)は0.01 であり,Ni と炭素以外のピークは観測されなかった。 STM 像の暗い点が炭素原子に対応し,CO の解離で生成 する炭素原子はステップエッジ近傍に局在することがわ



Fig. 6. STM current image of a C/Ni(111) surface observed after exposure to 1 L CO at 400 K (336 × 336 , I_t = 0.61 nA, V_s = - 0.01 V). The degree of coverage, C (θ_c), was estimated to be ~ 0.01 from the STM image.

かる。すなわちメタネーション反応においてステップエ ッジが CO 解離の活性点であると考えている。

Goodman ら¹は Ní(111), Ní(100), アルミナ担持 Ni 触媒のメタネーション反応に対する活性化エネルギーと ターンオーバー頻度が等しいことから Ni 触媒を用いた メタネーション反応は構造鈍感 (structure insensitive) で あると報告している。また H2S の解離吸着による少量 の硫黄が触媒表面を被覆することにより触媒活性が急激 に低下するが,これは1個の硫黄原子が10個のNi表面 原子の電子状態を変化させるためであると考察してい る。この代表的な構造鈍感と呼ばれる反応に対して新し いモデルを提示する。すなわち,触媒表面に少量存在す る活性点が硫黄によって効果的に被毒されている可能性 が考えられる。事実,我々のSTMの結果ではCOの解 離はステップエッジで起こっており,さらに表面に少量 存在する硫黄がステップエッジ近傍に局在することを示 している。したがって構造鈍感な反応であるからといっ て,ステップエッジなどの特殊な活性点が必要ないとは いえない。COの解離は真空下でも容易に進むほど速度 の大きい素過程である。一方,解離で生じたカーバイド 状炭素の水素化は遅く,律速過程と考えられる。カーバ イドの水素化が構造鈍感であればメタネーション反応が 構造鈍感であると説明できる。田中らは, Ni(100)とNi (111)上のカーバイドの局所構造が同じであることを報 告し,この結果がメタネーションの構造鈍感な性質の原

因と考えている¹⁸)。以上述べたように我々は新しいモデ ルとしてメタネーション反応にとってステップエッジが 活性点の1つとして必要であり硫黄原子は選択的にステ ップエッジを被毒すると考えられる。

4.ま と め

N(111) 表面に H₂S を導入すると Ni 表面のステップ エッジ近傍に $f(2 \times 2)$ S 構造と $(5\sqrt{3} \times 9)$ rect 構造の アイランドが局在するとともに,テラスには硫黄からな る特異なひも状物質が均等に分布することを STM で観 察した。この結果は H₂S はステップエッジおよびテラ スの両方で解離することを意味する。一方,メタネーシ ョン反応の素過程である CO の解離はステップエッジで 起こることを我々は示してきた。したがって,少量の硫 黄による Ni 触媒の著しい被毒はステップエッジの被毒 であると結論した。本結論はまた Ni 触媒によるメタネ ーション反応が構造鈍感な反応であるからといって,ス テップエッジが必要でないということにはならないこと を意味している。

文 献

- 1) D.W. Goodman: J. Vac. Sci. Technol. 20, 3 (1982).
- T. Zambelli, J. Wintterlin, J. Trost and G. Ertl: Science 273, 1688 (1996).

- S. Dahl, A. Logadottir, R.C. Egeberg, J.H. Larsen, I. Chorkendorff, E. Törnqvist and J.K. Nørskov: Phys. Rev. Lett. 83, 1814 (1999).
- 4) 志水隆一, 吉原一紘: "ユーザーのための実用オー ジェ電子分光法"(共立出版, 1989) p. 222.
- 5) P. Sautet: Chem. Rev. 97, 1097 (1997).
- A. Grossmann, W. Erley and H. Ibach: Surf. Sci. 337, 183 (1995).
- D.E. Gardin, J.D. Batteas, M.A. Van Hove and G.A. Somorjai: Surf. Sci. 296, 25 (1993).
- V. Maurice, N. Kitakatsu, M. Siegers and P. Marcus: Surf. Sci. 373, 307 (1997).
- L. Ruan, I. Stensgaard, F. Besenbacher and E. Lægsgaard: J. Vac. Sci. Technol. B 12, 1772 (1994).
- S. Tsukawaki, Y. Hatano, K. Hashizume and M. Sugisaki: Surf. Sci. 457, 63 (2000).
- K. Haug and T. Jenkins: J. Phys. Chem. B 104, 10017 (2000).
- A.G. Baca, M.A. Schulz and D.A. Shirley: J. Chem. Phys. 81, 6304 (1984).
- 13) D.R. Huntley: Surf. Sci. 240, 13 (1990).
- 14) R. Steudel, Y. Steudel and K. Miaskiewicz: Chem. Eur. J. 15, 3281 (2001).
- 15) A.H. Otto and R. Steudel: Eur. J. Inorg. Chem. 2057 (1999).
- 16) H. Yang and J.L. Whitten: Surf. Sci. 370, 136 (1997).
- H. Nakano and J. Nakamura: Surf. Sci. 482 485, 341 (2001).
- 18) H. Hirano and K. Tanaka: J. Catal. 133, 461 (1992).